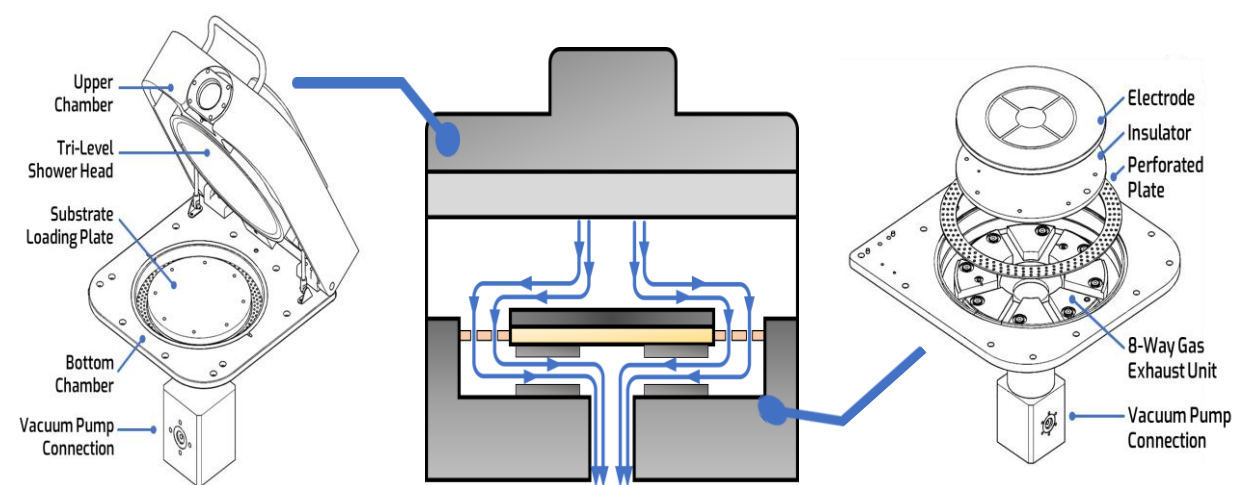


真空プラズマエッチング装置 VITAシリーズ

VITAシリーズは、研究や試作目的の使用に開発されました。
簡単な操作で使用でき、エッチングやアッシングに最適です。



●独自のガスフロー設計

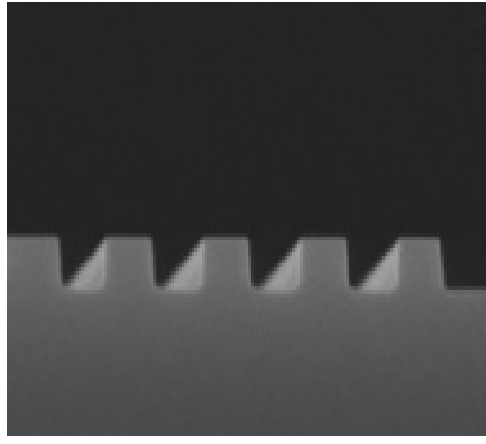


A uniform vertical gas flow is induced by applying a perforated plate, and 8-way flow line assembly that lead to a single exhaust port at the bottom.

機種名	VITA8	VITA12
チャンパー	9.2インチ	14.4インチ
プラズマモード	R I E	
周波数/出力	13.56MHz/MAX600W	13.56MHz/MAX1000W
MFC	Max. 200sccm	Max. 500sccm
ガス導入口	1 (マスフローコントローラ) *オプションで5個追加可能	1 (マスフローコントローラ) *オプションで5個追加可能
装置寸法	W680×D1,030×H1,200	W748×D1,139×H1,220

Applications

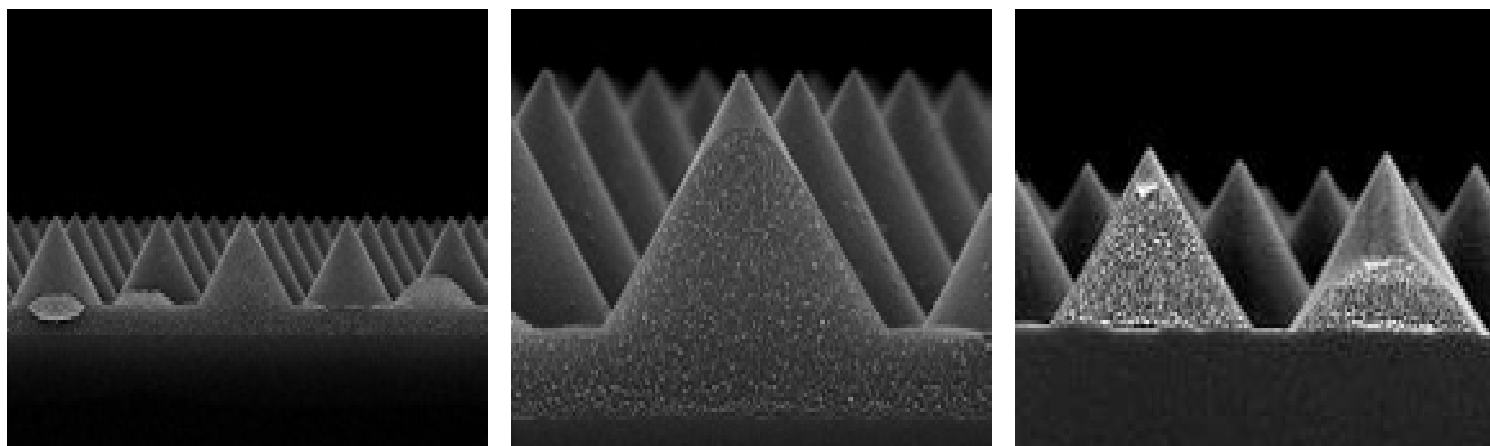
Semiconductor



Process Recipe

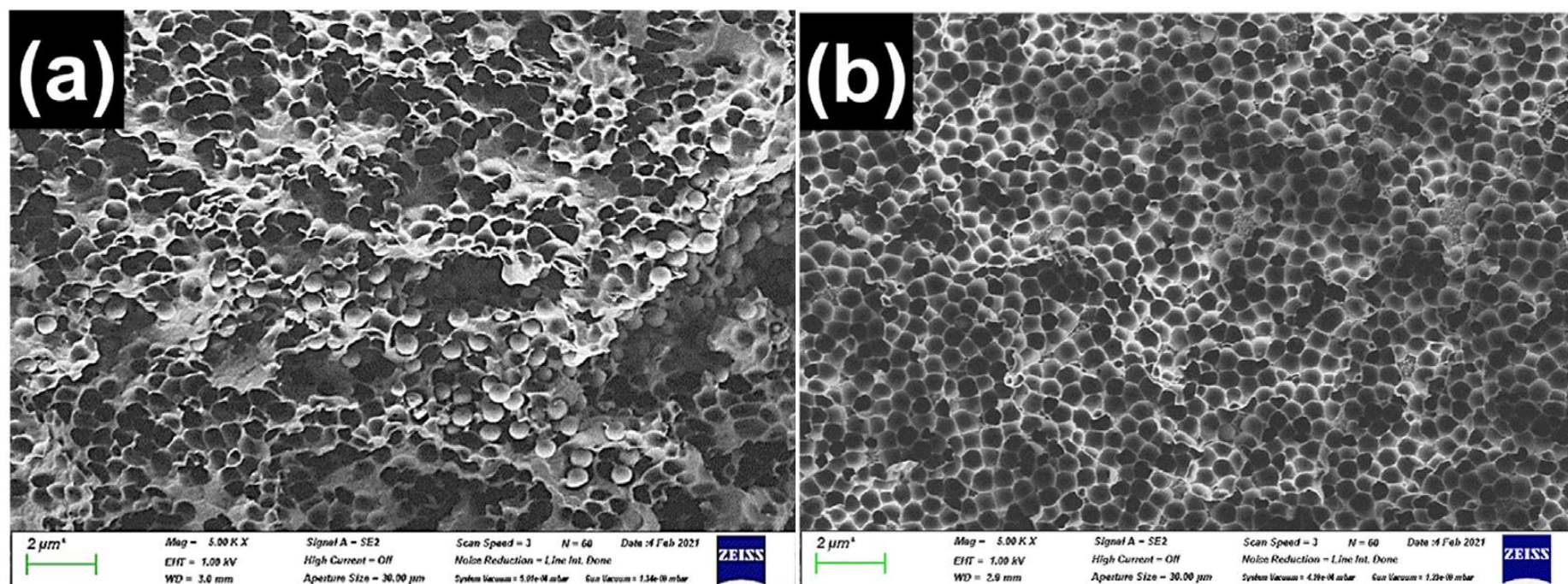
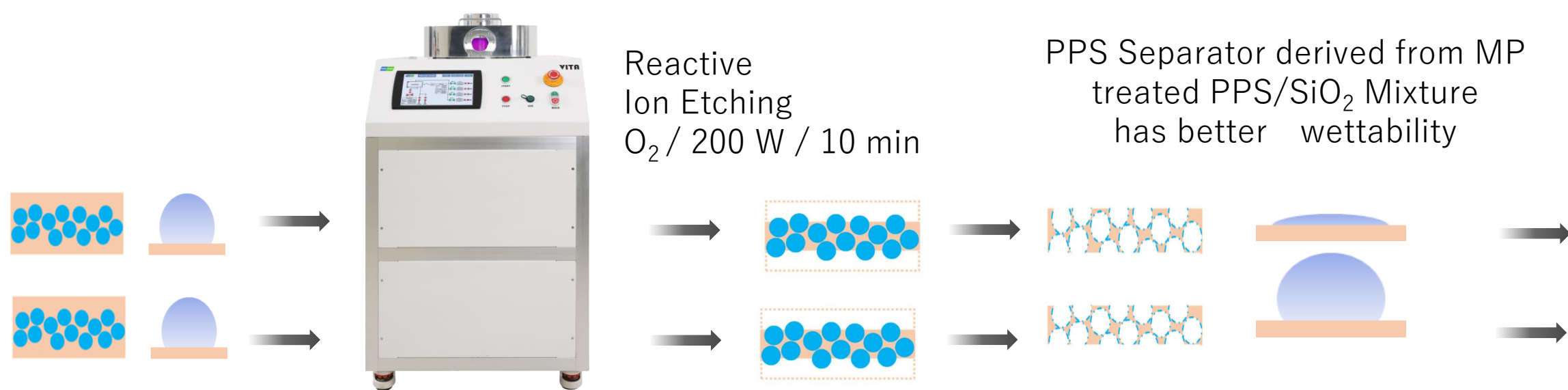
- CF_4 : 5 sccm, CHF_3 : 25 sccm , Ar : 70 sccm
- Pressure : 130 mTorr
- RF Power : 600W
- Chuck Temp. : 20°C
- ~ 2000Å/min
- Selectivity (PR : SiO_2) = 1:3

Removal of OLED Imprinting Residue



Removal Rate

- 70~100 nm/min (Typical)
- 30~40 nm/min (Soft)



a) PPS membrane made from untreated PPS/ SiO_2 Composite
 - Severely aggregated SiO_2
 - Sparsely found pores

b) PPS membrane made from MP treated PPS/ SiO_2 Composite
 - Uniform Pore Diameters
 - Through-Channels all over

FEMTO SCIENCE 国内総代理店

株式会社 新興精機

大阪営業所 〒564-0052 吹田市広芝町4-1江坂ミナビル403

TEL: 06-6389-6220 FAX:06-6389-6221

● 本社 / 〒812-0054 福岡市東区馬出6丁目14番17号

TEL: 092-624-8010 FAX:092-624-8024

● 営業所 / 北九州・佐賀・熊本・宮崎・鹿児島・東京・名古屋

● カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。

● カタログの写真や色は印刷により異なる場合があります。

● 本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

● このカタログの制作は2024年8月です。